



Torino, 25 luglio 2019

**OGGETTO:** Procedura aperta ai sensi dell'art. 60, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento della fornitura di un sistema Inductively Coupled Plasma Chemical Vapor Deposition (ICPCVD)

CIG 796950211A - CID 321-15 - CUP E15D18000350007 - CUI F00518460019201900102

### **Convocazione I Seduta pubblica**

Si comunica che il giorno **09 settembre 2019 alle ore 10:00**, presso la Saletta B del Rettorato sita al primo piano dell'Ateneo in C.so Duca degli Abruzzi, 24 - Torino, si terrà la prima seduta pubblica relativa alla procedura in oggetto, nel corso della quale si procederà all'apertura dei plichi pervenuti ed alla ricognizione pubblica del contenuto documentale delle buste contenenti la documentazione amministrativa.

Ufficio Appalti